# ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА АДСОРБЦИЮ КИСЛОРОДА НА ПОВЕРХНОСТИ Ті₅Si₃(0001)

А. В. Бакулин<sup>а\*</sup>, Л. С. Чумакова<sup>a</sup>, С. Е. Кулькова<sup>a,b</sup>

<sup>а</sup> Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 634055, Томск, Россия

> <sup>b</sup> Национальный исследовательский Томский государственный университет 634050, Томск, Россия

> > Поступила в редакцию 19 января 2023 г., после переработки 31 января 2023 г. Принята к публикации 31 января 2023 г.

Методом проекционных присоединенных волн в рамках теории функционала электронной плотности изучено влияние примесей простых и переходных металлов, а также примесей внедрения (В, С, N) на адсорбцию кислорода на поверхности силицида титана Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Показано, что наибольшее изменение энергии адсорбции наблюдается для примесей второй половины 3*d*-5*d*-периодов, замещающих титан. Простые металлы и примеси внедрения также ведут к понижению взаимодействия кислорода с поверхностью. Проведенный анализ локальных плотностей электронных состояний, распределения разности зарядовой плотности, зарядового переноса и заселенности связей кислорода с поверхностью силицида титана. Обсуждаются факторы, ответственные за увеличение/уменьшение энергии адсорбции кислорода на легированной поверхности. Выявлена корреляция между изменение энергией адсорбцией и электроотрицательностью примесей.

**DOI:** 10.31857/S0044451023060056 **EDN:** DEGXME

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что силициды переходных металлов интенсивно изучаются с начала 50-х годов прошлого столетия, но интерес к ним остается неизменным из-за их важных технологических приложений в микроэлектронике [1–3]. Металлические силициды широко используются в качестве локальных контактов в устройствах на основе металлоксид-полупроводниковых элементов из-за их низкого удельного сопротивления, высокой термической стабильности, а также совместимости со стандартной кремниевой технологией [3]. Кроме приложений в микро- и оптоэлектронике [4] металлические силициды рассматриваются как перспективные материалы для аэрокосмической техники изза низкой плотности, высокой температуры плавления (> 2000°C), высокого сопротивления ползучести и стойкости к окислению при повышенных температурах. Стремление повысить рабочую температуру известных конструкционных материалов и, в первую очередь, интерметаллидов, которые имеют также высокие температуры плавления и обладают хорошими механическими свойствами, привело к их обширным исследованиям и позволило сформулировать основные требования к материалам для высокотемпературных приложений [5–8]. Среди них низкая плотность, высокая прочность и хорошая стойкость к окислению при высоких температурах, а также возможности для легирования или композитирования. В настоящее время, несмотря на интенсивные исследования, не существует строгого теоретического объяснения влияния легирующих добавок и их комбинаций на функциональные свойства даже наиболее изученных интерметаллилов, среди которых алюминиды титана. При легировании сплава ү-TiAl ниобием и кремнием на внутреннем интерфейсе наблюдается формирование пленки силицида титана состава Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, с которой связывается положительный эффект на стойкость к окислению данного сплава [9]. Такой же эффект наблюдается и в слу-

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> E-mail: bakulin@ispms.tsc.ru

чае холодного напыления Al-40Si (мас.%) на поверхность сплава [10], при этом отмечается формирование диффузионного покрытия  $Ti(Al, Si)_3$ . Как считают авторы [10], образовавшийся стабильный диффузионный барьер из фазы  $Ti_5Si_3$  может тормозить интердиффузию между покрытием и подложкой и способствовать формированию пленки  $Al_2O_3$ . Именно с формированием плотного и защитного слоя  $Al_2O_3$  связывается высокая стойкость к окислению алюминия и сплавов Ti–Al с низким содержанием титана [11].

Необходимо отметить, что сам силицид титана со стехиометрией Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> считается также перспективным кандидатом для высокотемпературных приложений. Он имеет высокую температуру плавления (2130°С) и удельную прочность, а также обладает хорошим сопротивлением ползучести, а плотность данного материала составляет 4.32 г/см<sup>3</sup> [12]. Однако серьезными недостатками этого соединения являются, прежде всего, его хрупкость, недостаточная стойкость к высокотемпературному окислению, а также сложность его синтеза при температурах выше 1600°С. Физико-химические и механические свойства силицида титана интенсивно изучались в литературе [13–15], при этом теоретическими методами в основном исследовалась бинарная система. В частности, в работе [13] зонная структура и плотности электронных состояний (ПЭС) Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> были рассчитаны полуэмпирическим расширенным методом Хюккеля (Hückel), что позволило авторам выявить механизм химической связи в объемном соединении и объяснить его хорошую электропроводность. В дальнейшем расчеты электронной структуры Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> проводились полно-потенциальным линейным методом МТ-орбиталей (FLMTO) в работе [14]. На основе распределения зарядовой плотности был сделан вывод, что природа Ті-Si-взаимодействия является более сложной, чем описанная ранее на основе простой двухатомной ковалентной связи. Рассчитанные значения модуля упругости и энтальпии образования были лишь незначительно ниже, чем экспериментальные. Детальные расчеты электронной структуры и упругих свойств пяти фаз силицида титана были проведены методом проекционных присоединенных волн (PAW) в работе [15]. Были рассчитаны константы упругости  $C_{ij}$  и разные упругие модули, а также характеристики на их основе. Энтальпия образования различных фаз силицида титана рассчитывалась также в нескольких работах [16–19] с использованием методов ab initio в рамках теории функционала плотности. В то же время влияние примесей на фундаментальные свой-

797

ства Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> изучалось в меньшей степени (см. работы [20-25] и ссылки в них). Влияние примесей замещения на упругие свойства изучалось методом псевдопотенциала в работах [20, 21]. Следует отметить, что в отличие от силицидов титана других составов, возможности легирования Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, имеющего гексагональную структуру, выражены в большей степени. Известно, что решетка данного соединения может вместить до 11 ат.% таких атомов, как B, C, N. В работах [22,23] было экспериментально показано, что внедрение атомов C, N, O приводит к уменьшению параметров решетки соединения Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>, а также к понижению анизотропии его свойств, например, коэффициента теплового расширения. Кроме того, эксперимент показал, что добавление В [22] и Si [23], напротив, ведет к увеличению параметров решетки. Согласно расчетам [22], проведенным линейным методом МТ-орбиталей в приближении атомной сферы (LMTO-ASA), только внедрение кислорода ведет к незначительному уменьшению параметров решетки, хотя все рассмотренные примеси усиливают межатомные связи в Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Экспериментальное изучение Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> с добавками бора, углерода, азота и кислорода проводилось также в работе [24]. Методом рентгеновской дифракции было показано, что примесные атомы располагаются в междоузлиях, при этом связь между ними и атомами титана приводит к уменьшению объема междоузлий, в результате чего наблюдаются значительные изменения длин связей. Наиболее заметно увеличивается длина связи между атомами титана 6g-симметрии и кремнием, тогда как длина связи между атомами титана, напротив, уменьшается. Влияние азота на скорость окисления Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> детально изучалось в работе [25]. Было показано, что медленное окисление по параболическому закону, которое происходит в атмосфере кислорода, сменяется быстрым окислением по линейному закону в атмосфере азота. Растрескивание и осыпание оксидной шкалы происходит даже при кратковременной выдержке, если в окислительной среде содержится более 75% N<sub>2</sub>, а скорость реакции повышается с увеличением концентрации азота. Авторы [25] объяснили негативное влияние азота образованием на границе раздела оксид/подложка фазы TiN, которая в дальнейшем окисляется до TiO<sub>2</sub>, препятствуя образованию сплошного защитного слоя  $SiO_2$ .

В наших ранних работах было проведено изучение электронной и фононной структуры  $Ti_5Si_3$ , механических, термодинамических и тепловых свойств [26], а также поверхностной структуры [27]. Было показано, что наиболее стабильной является поверх-

ность Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001)<sub>TiSi</sub> со смешанным окончанием. Был определен механизм взаимодействия кислорода с данной поверхностью. В работе [28] рассматривалась также диффузия кислорода в объемном соединении. Следует отметить, что внедрение кислорода в междоузлие уменьшает объем ячейки примерно на 2.21 Å<sup>3</sup>. В пересчете на относительные единицы и в терминах работ [22] получаем, что добавление 0.5 кислорода понижает объем ячейки Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> примерно на 0.9%, что удовлетворительно согласуется с результатом около 1% при концентрации кислорода 0.4 [22]. Влияние примесей на адсорбционные свойства Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> ранее не исследовалось. Таким образом, целью настоящей работы является изучение влияния примесей переходных и простых металлов, а также B, C и N на адсорбцию кислорода на стабильной поверхности Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001) со смешанным окончанием.

#### 2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Расчеты атомной и электронной структуры  $Ti_5Si_3(0001)$  выполнены методом поверхности проекционных присоединенных волн (PAW) в плоско-волновом базисе [29, 30]. Для обменнофункционала использовалось корреляционного обобщенное градиентное приближение (GGA-PBE) [31]. Максимальная энергия плоских волн из базисного набора составила 550 эВ. Известно, что в Ті<sub>5</sub>Sі<sub>3</sub> атомы титана занимают позиции Вайкоффа (Wyckoff) двух типов симметрии: 4d (1/3, 2/3, 0) и 6q (0.250, 0, 1/4), тогда как атомы кремния находятся в позициях 6q (0.608, 0, 1/4). Теоретические параметры решетки a = 7.466 Å и c = 5.108 Å отличаются от экспериментальных [32] менее, чем на 0.8%.

Для расчета атомной и электронной структуры поверхности  $Ti_5Si_3(0001)$  использовался подход многослойных пленок, разделенных вакуумным промежутком не менее 15 Å. Поверхность  $Ti_5Si_3(0001)$ со смешанным TiSi-окончанием моделировалась 10слойной несимметричной пленкой, при этом атомные позиции трех слоев с одной стороны пленки были фиксированы при объемных значениях. В поверхностном слое находилось равное число атомов титана и кремния, тогда как подповерхностный слой состоял только из атомов титана (рис. 1*a*). Релаксация атомных позиций остальных слоев проводилась методом сопряженных градиентов до тех пор, пока силы на атомах не уменьшались примерно до 0.01 эВ/Å. В расчетах использовалась Гцентрированная сетка из k-точек  $7 \times 7 \times 1$ .

Энергия адсорбции кислорода на легированной поверхности рассчитывалась по следующей формуле:

$$E_{ads} = -\left[E_{O/Ti_5Si_3X} - E_{Ti_5Si_3X} - \frac{1}{2}E_{O_2}\right], \quad (1)$$

где  $E_{\rm O/Ti_5Si_3X}$  и  $E_{\rm Ti_5Si_3X}$  – полные энергии легированной поверхности с кислородом и без него, а  $E_{\rm O_2}$  – полная энергия молекулы кислорода, X – легирующий элемент в поверхностном слое. Коэффициент 1/2 соответствует адсорбции одного атома кислорода на одной поверхности пленки.

#### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее в работе [27] было установлено, что энергетически предпочтительной для адсорбции кислорода на чистой поверхности Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001)<sub>TiSi</sub> является F1-позиция, энергия адсорбции в которой достигает 6.13 эВ. В данной позиции адатом кислорода трехкратно координирован атомами титана и располагается над естественным каналом для диффузии в кристаллической структуре силицида (рис. 16). Во второй по предпочтительности F2-позиции, в которой вблизи кислорода находится также атом кремния, энергия адсорбции на 0.83 эВ меньше, чем в F1. Расчеты вероятности нахождения кислорода в данных позициях показали, что не менее 98% всех адатомов кислорода будут занимать именно F1позицию. В целом в [27] был сделан вывод, что механизм химической связи кислорода с Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001)<sub>TiSi</sub> носит преимущественно ионный характер, а уменьшение переноса заряда к адатому коррелирует с уменьшением энергии адсорбции в изученных позициях [27]. Например, в F1-позиции кислород получает 0.76 эл., тогда как в F2 – лишь 0.48 эл. Необходимо отметить, что примеси, согласно расчетам энергий образования дефекта, могут замещать атомы титана как с 4d-, так и с 6g-симметрией, однако замещение кремния требует значительно большей энергии. Поскольку атомы Ti<sub>4d</sub> находятся на расстоянии примерно 5 Å от адатома кислорода, то эффект от их замещения, во-первых, очень слабо выражен, а, во-вторых, обусловлен не изменением химической связи кислорода с поверхностью, а изменением поверхностной энергии. Аналогичный эффект был найден при адсорбции кислорода в H<sub>Al</sub>позиции на поверхности Ti<sub>3</sub>Al(0001) в нашей работе [33]. Поэтому в настоящей работе примесным атомом замещался один из трех ближайших к кисло-



Рис. 1. Атомная структура поверхности  $Ti_5Si_3(0001)$  с кислородом, адсорбированным в наиболее предпочтительной позиции: вид сбоку (*a*); вид сверху (*б*). Позиция примесного атома на Ti-подрешетке 6*g*-симметрии показана крестиком



Рис. 2. Изменение энергии адсорбции кислорода ( $\Delta E_{ads}$ ) на поверхности Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001)<sub>TiSi</sub> в зависимости от примеси на Ti<sub>6g</sub>-подрешетке

роду поверхностных атомов титана с 6*g*-симметрией (рис. 1).

Изменение энергии адсорбции вследствие легирования показано на рис. 2. Видно, что практически все примеси понижают  $E_{ads}$ ; исключение составляют только элементы начала *d*-периодов. В целом тенденции в изменении энергии адсорбции для металлов трех *d*-периодов подобны, а наиболее выраженный эффект оказывают примеси второй половины периодов. Для объяснения данного эффекта обсудим особенности атомной и электронной структуры легированной поверхности с кислородом и без него.

В случае примесей Y и La повышение энергии адсорбции обусловлено увеличением ионной состав-

ляющей в механизме химической связи кислорода с поверхностью. Из таблицы следует, что перенос заряда от поверхности к адатому кислорода увеличивается примерно на 0.1 эл. (в таблице в качестве примера приведены данные только для La). Поскольку La имеет на один валентный электрон меньше, чем титан, то его валентная зона незначительно сдвинута в сторону положительных энергий, что приводит к сдвигу состояний, индуцированных О-La-взаимодействием, в этом же направлении (рис. 3а). Интересно отметить, что заселенность связи О-La незначительно изменяется по сравнению с О-Ті на чистой поверхности. Последнее может быть объяснено большей вовлеченностью s-состояний La во взаимодействие с кислородом. Карта распределения разности плотности заряда ( $\Delta \rho$ ) демонстрирует бо́льшую область ухода заряда от La по сравнению с Ті (рис.  $4a, \delta$ ). В то же время с противоположной стороны примесного атома располагается область аккумуляции заряда, что означает поляризацию лантана вследствие взаимодействия с кислородом.

В случае примесей изоэлектронных титану (IVB группы) перенос заряда к кислороду остается практически таким же, как и на нелегированной поверхности (см. Zr в таблице). При этом примесный атом Zr отдает несколько больший заряд, чем ближайшие атомы титана, уход заряда от которых слегка уменьшается по сравнению с чистой поверхностью. На рис. 36 можно видеть, что локальные плотности электронных состояний Zr слабо отличаются от ПЭС Ti: характерные пики располагаются при одинаковых энергиях, а различия заключаются в их высоте. Аналогичная ситуация характерна и для Hf. Распределение разности плотности заряда вблизи Zr

Примесь	-	La	Zr	Nb	Mo	Re	Cu
q(O), эл.	-0.76	-0.83	-0.75	-0.67	-0.60	-0.51	-0.64
q(Me), эл.	+0.98	+1.40	+1.11	+0.70	+0.33	-0.09	+0.21
$q(\mathrm{Ti})$ , эл.		+0.94	+0.96	+0.96	+0.94	+0.91	+0.96
$\chi(X),  \Im B^{-1/2}  [34]$	1.54	1.10	1.33	1.60	2.16	1.90	1.90
d(O–Me), Å	1.96	2.21	2.11	2.07	2.05	2.05	2.21
d(O–Ti), Å		1.91	1.96	1.95	1.94	1.96	1.90
$\theta$ (O–Me), эл.	0.48	0.50	0.49	0.54	0.56	0.62	0.27
$\theta$ (O-Ti), эл.		0.46	0.47	0.46	0.47	0.44	0.52
$R_{cov}(Me), \text{ Å } [35]$	1.60	2.07	1.75	1.64	1.54	1.51	1.32

Таблица 1. Зарядовые состояния адатома кислорода и ближайших к нему поверхностных атомов титана и примеси Ме, а соответствующие длины связей О-Ме и электроотрицательности примесей

подобно распределению  $\Delta \rho$  на нелегированной поверхности с той лишь разницей, что область аккумуляции рядом с Zr отсутствует (рис. 4*e*).

Заметим, что электроотрицательность и ковалентный радиус Nb незначительно превышают эти характеристики для Ті, поэтому перенос заряда к кислороду уменьшается лишь на 0.09 эл. по сравнению с нелегированной поверхностью (таблица), что может являться индикатором уменьшения ионного вклада в химическую связь кислорода с поверхностью. Большая на 0.06 эл. заселенность связи О-Nb, по сравнению с О-Ті, обусловлена увеличением числа валентных электронов Nb и указывает на повышение ковалентного вклада. Смещение состояний, обусловленных гибридизацией О-Nb, на соответствующих локальных ПЭС (рис. 36) также подтверждает некоторое усиление ковалентности связи. Описанные выше тенденции усиливаются при легировании молибденом: перенос заряда уменьшается на 0.16 эл., а заселенность перекрывания орбиталей О-Мо оказывается больше, чем О-Ті на 0.08 эл. (таблица). В этом случае локальные ПЭС гибридизированных состояний О-Мо сильнее сдвигаются в сторону отрицательных энергий (рис. 3г). Таким образом, легирование Nb и Мо приводит к уменьшению ионности связи кислорода с подложкой, но увеличивает ее ковалентность. В результате наблюдается уменьшение энергии адсорбции соответственно на 0.16 и 0.56 эВ. Электроотрицательность молибдена существенно больше, чем титана, поэтому область аккумуляции заряда вокруг примесного атома становится больше по сравнению с нелегированной поверхностью (рис. 4г).

Согласно проведенным расчетам, в случае простых металлов изоэлектронных алюминию их энергии образования на разных подрешетках не демонстрируют определенной закономерности: Al предпочитает замещать  $Ti_{4d}$ , In –  $Ti_{6q}$ , a Ga – Si. В то же время изоэлектронные кремнию элементы находятся на его подрешетке – минимальная разница в энергиях образования дефекта на Si- и двух Tiподрешетках составляет около 0.7 эВ. Тем не менее, если эти примеси замещают поверхностный атом Ті<sub>6а</sub>, то они уменьшают энергию адсорбции кислорода в ближайшей F1-позиции на 0.65-2.17 эВ (см. вставку на рис. 2). Данный эффект обусловлен как бо́льшим значением электроотрицательности этих элементов по сравнению с титаном, так и уменьшением ковалентности связи О-Ме из-за изменения характера гибридизации (с O p - Me d на O p - Me s, p). Более выраженное влияние элементов IVA группы связано именно с их более высокой электроотрицательностью по сравнению с элементами IIIА группы.

На рис. 2 можно видеть, что примеси внедрения, такие как B, C и N, понижают энергию адсорбции практически в одинаковой степени (на 0.78–0.85 эВ). Отметим, что примесный атом размещался в естественном канале для их диффузии непосредственно под атомом кислорода на уровне подповерхностного слоя. В этом случае равновесное расстояние между атомами примеси и кислорода составляло 2.5–2.6 Å. Другими словами, химическая связь между ними не образуется, а взаимодействие сводится к кулоновскому отталкиванию вследствие одноименности их заряда, поскольку оба неметалла имеют высокие значения электроотрицательности и выступают в качестве акцепторов. На рис. 5 можно видеть, что между атомами примеси внедрения и кислородом в результате адсорбции последнего образуется область ухода заряда. Такая картина перераспределе-



Рис. 3. Локальные ПЭС поверхностных и подповерхностных атомов при адсорбции кислорода на поверхности Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001) с примесями La (*a*), Zr (*b*), Nb (*b*), Mo (*b*), Re (*d*) и Cu (*b*). Символы S и S-1 обозначают поверхностные и подповерхностные атомные слои. Заливкой показаны ПЭС атомов на нелегированной поверхности

ния зарядовой плотности свидетельствует об электростатическом отталкивании между атомами примеси и кислорода. В пользу нехимического взаимодействия говорит также практически полное отсутствие гибридизированных состояний О–Х на парциальных ПЭС (рис. 6). Отметим, что с заполнением *p*-оболочки примеси (Х) ее *s*-состояния сильно смещаются в сторону отрицательных энергий. В случае В пик *s*-состояний расщепляется на два, что обусловлено взаимодействием с ближайшими атомами. Главные пики *s*-состояний С и N расположены в области –10.6 и –15.0 эВ и не показаны на рис. 6*б.6.* Они имеют атомоподобную структуру (резкий узкий пик) и практически не вовлекаются во взаимодействие с ближайшими атомами титана.

В заключение обсудим некоторые корреляции между изменением энергии адсорбции кислорода и рядом характеристик примесных атомов. Поскольку доминирующим механизмом химической связи является ионный, то логично предположить, что уменьшение энергии связи должно коррелировать с увеличением электроотрицательности примесного атома. На рис. 7*a* видно, что распределение металлов по  $\Delta E_{abs}$  и  $\chi$  носит неслучайный характер, а коэффициент корреляции *r* достигает –0.84. Наибольшее отклонение от прямой, построенной ме-



Рис. 4. Распределение разности плотности заряда ( $\Delta \rho = \rho(O) + \rho(Ti_5Si_3) - \rho(O/Ti_5Si_3)$ ) для чистой поверхности (*a*) и с примесями (*б*-*e*). Области аккумуляции и ухода заряда показаны синим и красным цветом. Поверхности постоянной плотности соответствуют заряду 0.015 эл./Å<sup>3</sup>. Обозначения атомов как на рис. 1



**Рис. 5.** Распределение разности плотности заряда в случае примесей внедрения В (*a*), С (*б*) и N (*b*). Области аккумуляции и ухода заряда показаны синим и красным цветом. Изолинии проведены от -0.1 до 0.1 эл./Å<sup>3</sup> с шагом 0.01 эл./Å<sup>3</sup>

тодом наименьших квадратов, демонстрируют элементы с полностью заполненной d-оболочкой, такие как Zn, Cd, Hg (рис. 7*a*), а также некоторые другие металлы, например, Мо и Ti. В целом с заполнением d-оболочки примеси электроотрицательность возрастает, но для ряда металлов эта тенденция нарушается. Именно такие элементы демонстрируют наибольшее отклонение от линии тренда на рис. 7*a*. В частности, электроотрицательность Zn, Cd и Hg скачкообразно понижается по сравнению с элементами, стоящими левее в периодической таблице, тогда как изменения энергии адсорбции остают-



**Рис. 6.** Локальные ПЭС поверхностных и подповерхностных атомов при адсорбции кислорода на поверхности Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001) с примесями В (*a*), С (*б*) и N (*e*). Символы *S* и *S*-1 обозначают поверхностные и подповерхностные атомные слои. Заливкой показаны ПЭС атомов на нелегированной поверхности



**Рис. 7.** Корреляция между изменением энергии адсорбции кислорода на поверхности Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001) и электроотрицательностью (*a*) и ковалентным радиусом (*б*) примесного атома

ся практически такими же (рис. 2). Как результат, точки Zn, Cd и Hg на рис. 7*a* лежат значительно левее линии тренда. Напротив, электроотрицательность Mo и Ti резко увеличивается по сравнению с элементами, стоящими левее, а  $\Delta E_{ads}$  уменьшается не так радикально, поэтому соответствующие точки на рис. 7*a* лежат правее линии тренда. Таким образом, увеличение электроотрицательности по сравнению с титаном (1.54 эВ<sup>-1/2</sup>) приводит к уменьшению энергии адсорбции вследствие уменьшения ионного вклада в механизм химической связи кислорода с поверхностью. Чем больше значение  $\chi$ , тем сильнее уменьшается  $E_{abs}$ . При  $\chi < 1.54$  эВ<sup>-1/2</sup> значительного возрастания энергии адсорбции не наблюдается, поскольку увеличение ионности связи частично компенсируется увеличением расстояния О–Х (увеличением ковалентного радиуса примеси) и/или уменьшением числа валентных электронов примеси, которые вовлекаются во взаимодействие.

Другой характеристикой, с которой может быть связано изменение энергии адсорбции, является размер примесей, а именно, их ковалентный радиус. Выбор этого радиуса обусловлен его физическим смыслом, поскольку он равен половине

длины ковалентной связи в простом веществе. На рис. 76 проведено сопоставление полученных значений  $\Delta E_{ads}$  и  $R_{cov}$  примесных элементов 3d-5dпериодов. Видно, что, как и в предыдущем случае, распределение носит неслучайный характер, а увеличение ковалентного радиуса металла ведет к увеличению энергии абсорбции. Коэффициент корреляции в этом случае равен 0.81. Интересно, что данное наблюдение контринтуитивно, поскольку естественно ожидать ослабление взаимодействия О-Ме с увеличением длины связи, а значит, и увеличением атомного размера металла. Однако объяснение данного явления заключается в том, что длина связи О-Ме не связана напрямую с размером Ме атома. Известно, что в целом с заполнением *d*-оболочки примеси ее атомный размер уменьшается, а длина связи О-Ме, например, в оксидах этих металлов, напротив, увеличивается вследствие понижения их химической реактивности. На рис. 76 большее число элементов демонстрирует отклонение от линии тренда (сплошная прямая), чем на рис. 7а. Больший разброс связан с тем, что все 3*d*-металлы располагаются выше этой линии, а 4*d*- и 5*d*-металлы второй половины периодов – ниже. Если провести прямые методом наименьших квадратов для этих групп примесей по отдельности (пунктирные линии на рис. 76), то коэффициенты корреляции достигают значений 0.97 (3*d*-металлы) и 0.93 (4*d* и 5*d*) соответственно. Дополнительно отметим, что 3d-металлы в основном являются магнитными, однако на поверхности немагнитного силицида титана их магнитный момент существенно понижается. Последнее ведет к повышению энергии адсорбции и отклонению от общей линии тренда. Кроме того, на рис. 76 можно видеть также, что металлы с  $R_{cov} > 1.7$  Å, т.е. элементы начала *d*-периодов, слабо влияют на энергию адсорбции. Данная тенденция отмечалась ранее на рис. 2.

### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влияние примесей на адсорбцию кислорода на стабильной поверхности силицида титана Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>(0001) со смешанным TiSi-окончанием изучено с использованием метода проекционных присоединенных волн. Проведен анализ особенностей химических связей между поверхностными атомами и кислородом в предпочтительной позиции адсорбции для ряда представительных примесей. Рассчитаны плотности электронных состояний атомов поверхностных слоев, карты распределения разности

804

зарядовой плотности, заселенности связей между кислородом и ближайшими к нему поверхностными атомами, а также оценен перенос заряда к адсорбату. Показано, что наибольшее изменение энергии адсорбции наблюдается для примесей второй половины 3*d*-5*d*-периодов, что обусловлено понижением ионного вклада в химическую связь между адсорбатом и поверхностью. Хотя с заполнением электронами *d*-оболочек увеличивается ковалентный вклад в химическую связь, но его увеличение не компенсирует эффект, связанный с уменьшением переноса заряда от поверхности к адсорбату. Примеси простых металлов также уменьшают энергию адсорбции кислорода, если они замещают титан. Этот эффект связан как с увеличением электроотрицательности данных элементов по сравнению с титаном, так и с понижением ковалентности связи вследствие изменения характера гибридизации орбиталей кислорода с примесными атомами. Примеси внедрения практически не образуют химических связей с адсорбатом, находясь в подповерхностном слое, а их взаимодействие с кислородом сводится к кулоновскому отталкиванию. В целом полученные результаты указывают на корреляцию между электроотрицательностью примесных атомов и изменением энергии адсорбции кислорода на легированной поверхности. Установлена предпочтительность взаимодействия кислорода с титаном, чем с примесными атомами. Хотя мы не обсуждали в данной статье изменения межатомных связей вследствие нахождения атомов внедрения в подповерхностных слоях, но вывод об их влиянии (упрочнение связей в подложке) согласуется с ранее сделанным в работах [22–24] для объемного соединения. В целом результаты данной работы позволяют понять механизмы окисления поверхности силицида титана на начальном этапе.

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-23-00078). Численные расчеты проводились на суперкомпьютере СКИФ Суberia в Томском государственном университете.

# ЛИТЕРАТУРА

- H. Nowotny, in *Electronic Structure and Alloy* Chemistry of the Transition Elements, ed. by P. A. Beck, Intersci. Publ., New York (1963), p. 179.
- S. P. Murarka, Silicides for VLSI Applications, Academic Press, New York (1983).
- **3.** L. J. Chen, *Silicide Technology for Integrated Circuits*, IEE, London (2009).

- J. Derrien, J. Chevrier, V. Le Thanh et al., Appl. Surf. Sci. 56, 382 (1992).
- D. L. Anton, D. M. Shah, D. N. Duhl et al., JOM 41, 12 (1989).
- 6. R. L. Fleischer, J. Mater. Sci. 22, 2281 (1987).
- D. M. Shah, D. Berczik, D. L. Anton et al., Mater. Sci. Eng. A 155, 45 (1992).
- R. L. Fleischer, D. M. Dimiduk, and H. A. Lipsitt, Annu. Rev. Mater. Sci. 19, 231 (1989).
- R. Swadźba, L. Swadźba, B. Mendala et al., Intermetallics 87, 81 (2017).
- J. Huang, F. Zhao, X. Cui et al., Appl. Surf. Sci. 582, 152444 (2022).
- Z. Li and W. Gao, in *Intermetallics Research Progress*, ed. by Y. N. Berdovsky, Nova Sci. Publ., New York (2008), p. 1.
- Z. Tang, J. J. Williams, A. J. Thom et al., Intermetallics 16, 1118 (2008).
- X. Long and Z. Chong, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 4, 25 (1994).
- 14. M. Ekman and V. Ozolins, Phys. Rev. B 57, 4419 (1998).
- 15. M. K. Niranjan, Mater. Res. Express 2, 096302 (2015).
- C. Colinet, W. Wolf, R. Podloucky et al., Appl. Phys. Lett. 87, 041910 (2005).
- 17. G. Shao, Acta Mater. 53, 3729 (2005).
- T. Wang, J. A. Chen, X. Ling et al., Mod. Phys. Lett. B 20, 343 (2006).
- C. Colinet and J. C. Tedenac, Intermetallics 18, 1444 (2010).
- H. Y. Wang, W. P. Si, S. L. Li et al., J. Mater. Res. 25, 2317 (2010).

- P. F. Zhang, Y. X. Li, and P. K. Bai, IOP Conf. Series: Mater. Sci. Eng. 284, 012013 (2017).
- 22. J. J. Williams, Y. Y. Ye, M. J. Kramer et al., Intermetallics 8, 937 (2000).
- 23. J. J. Williams, M. J. Kramer, M. Akinc et al., J. Mater. Res. 15, 1773 (2000).
- 24. A. J. Thom, V. G. Young, and M. Akinc, J. Alloys Compd. 296, 59 (2000).
- 25. Z. Tang, A. J. Thom, and M. Akinc, Intermetallics 14, 537 (2006).
- 26. Л. С. Чумакова, А. В. Бакулин, С. Е. Кулькова, ЖЭТФ 161, 874 (2022).
- 27. L. S. Chumakova, A. V. Bakulin, S. Hocker et al., Metals 12, 492 (2022).
- 28. A. V. Bakulin, L. S. Chumakova, and S. E. Kulkova, Intermetallics 146, 107587 (2022).
- 29. P. E. Blöchl, Phys. Rev. B 50, 17953 (1994).
- 30. G. Kresse and D. Joubert, Phys. Rev. B 59, 1758 (1999).
- 31. J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- 32. P. Villars and L. D. Calvert, Pearson's Handbook of Crystallographic Data for Intermetallic Phases, ASM, Metals Park, OH (1985).
- 33. A. V. Bakulin, S. Hocker, S. Schmauder et al., Appl. Surf. Sci. 487, 898 (2019).
- 34. W. M. Haynes, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 96th Edition, CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL (2015), p. 9.
- 35. B. Cordero, V. Gómez, A. E. Platero-Prats et al., Dalton Trans. 21, 2832 (2008).